



ПОЛЮС БАС

**Инспекционный микроскоп для
контроля качества
полупроводниковых изделий MX68R**

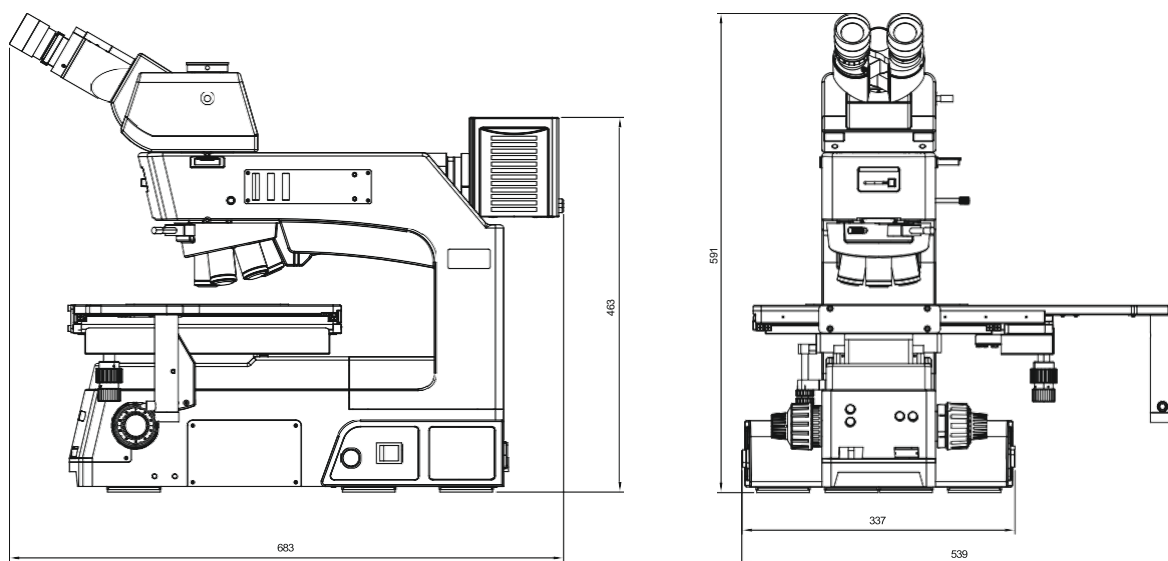
**Техническая
информация**

Инспекционный микроскоп для контроля качества полупроводниковых изделий MX68R



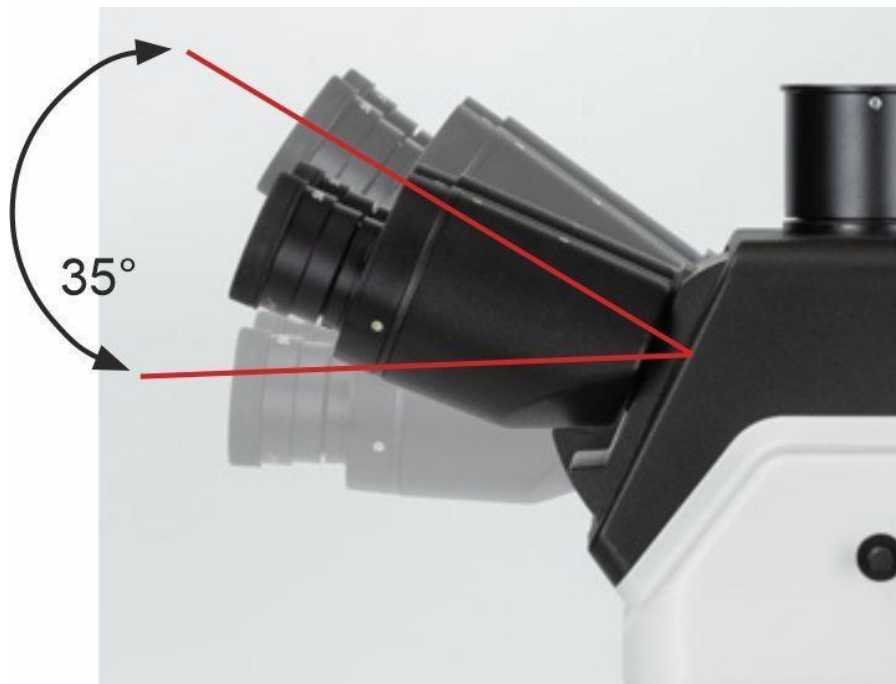
Модель инспекционного микроскопа MX68R оснащена держателями 4, 6 и 8 дюймов и применяется для инспекции полупроводниковых пластин диаметром до 200мм и плоских дисплеев с диагональю до 11 дюймов.

Габаритный чертёж



Основные преимущества

- Регулируемый угол наклона окулярных трубок (0-35°) позволяет подобрать оптимальный угол зрения, что сокращает утомляемость от длительной работы с микроскопом и значительно повышает её эффективность.



- На лицевой панели микроскопа расположены кнопки управления револьвером объективов и апертурной диафрагмой, что повышает удобство эксплуатации.



- Микроскоп MX68R оснащен двумя стальными стержнями по бокам рамы, создающими рычаг для удержания нагрузки.



- Светосильная диафрагма автоматически настраивается на различные цели, а система адаптивной подсветки автоматически включается в условиях затемнения.



- Удобный и устойчивый столик, оснащённый системой ручного управления, которая позволяет легко и плавно перемещать сцену.



Аксессуары для инспекционного микроскопа MX68R

ОКУЛЯРЫ С ШИРОКИМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ



- Окуляр 10X/22 мм для сохранения чёткости изображения по всему полю зрения;
- Окуляр 10X/23 мм позволяет получить максимально возможное поле зрения.

ОБЪЕКТИВЫ С БОЛЬШИМ РАБОЧИМ РАССТОЯНИЕМ



- В серии профессиональных полуапохроматических металлографических объективов установлены высококачественные линзы с просветляющим покрытием;
- Объективы с увеличенным рабочим расстоянием эффективно предотвращают повреждения образца.

Доступные объективы

Объектив	Кратность увеличения	Числовая Апертура (N.A.)	Рабочее фокусное расстояние, мм	Парфокальное – сопряжённое фокусное расстояние, мм
Полуапохроматический металлографический ДИК-объектив с бесконечной фокусировкой в светлом и темном поле	5X	0.15	13.5	45 - ∞
	10X	0.30	9.0	
	20X	0.50	2.5	
	50X	0.80	1.0	
	100X	0.90	1.0	
Полуапохроматический металлографический объектив с бесконечно длинной фокусировкой в светлом и темном поле	20X	0.40	8.5	45 - ∞
	50X	0.55	7.50	
	100X	0.80	2.10	
Полуапохроматический ДИК-объектив с бесконечной фокусировкой в светлом поле	5X	0.15	19.5	45 - ∞
	10X	0.30	10.9	
	20X	0.50	3.2	
	50X	0.80	1.2	
	100X	0.90	1.0	

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-КОНТРАСТНОЙ МИКРОСКОПИИ

(ДИК-микроскопия Номарского)



- При наблюдении в отраженном свете, ДИК-микроскопия позволяет создать объемное рельефное изображение за счет контрастности, зависящей от перепадов высоты на исследуемой поверхности;
- ДИК-микроскопия широко применяется для обнаружения дефектов (частиц, царапин) при проведении визуального контроля изделия.

Основные технические характеристики инспекционного микроскопа MX68R

Оптическая система	скорректированная на бесконечность
Режим наблюдения	светлое поле / Темное поле / Поляризация / ДИК-микроскопия
Тубус	тринокулярная головка на 5-35° (перевернутое изображение), регулировка межзрачкового расстояния на 50-76мм, деление светового потока: 100:0 или 0:100
Окуляры	PL10X/22 мм - с высокой окулярной точкой, широким полем зрения и с возможностью установки микрометра
	PL10X/23 мм - с высокой окулярной точкой, широким полем зрения, с диоптрической настройкой и с возможностью установки микрометра
Объективы	полуапохроматический объектив для светлого и темного поля с увеличением 5X/10X/20X
	полуапохроматический объектив со сверхбольшим рабочим расстоянием для светлого и темного поля с увеличением 20X
	полуапохроматический объектив с большим рабочим расстоянием для светлого и темного поля с увеличением 50X/100X
	полуапохроматический объектив для светлого и темного поля с увеличением 50X/100X
Револьверная головка	револьверная головка для светлого и темного поля с 6-ю объективами, оснащенными разъемами для ДИК-призмы
Рама	рама микроскопа для отраженного света с коаксиальным механизмом фокусировки с ходом 35 мм и точностью 0,001 мм, с регулировкой верхнего предела фокусировки и регулировкой усилия, со встроенным блоком питания с диапазоном напряжений 100В - 240В
	рама микроскопа для отраженного и проходящего света с коаксиальным механизмом фокусировки с ходом 35 мм и точностью 0,001 мм, с регулировкой верхнего предела фокусировки и регулировкой усилия, со встроенным блоком питания с диапазоном напряжений 100В - 240В
Столик	8-дюймовый трехуровневый механический столик размером 525мм X 330мм с рукояткой для быстрой коаксиальной регулировки с ходом 210мм X 210мм, стеклянная вставка
Осветитель	Осветитель отраженного света с электронной регулируемой диафрагмой и полевой диафрагмой, регулируемой по центру; с переключателем для изменения яркого и темного поля; со слотами для фильтров и поляризационного комплекта
Адаптер камеры	0,5X / 0,65X / 1X C-mount adapter
Дополнительные аксессуары	поляризационный комплект, интерференционный фильтр, высокоточный микрометр, ДИК-призма

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbas.ru 🌐 www.polusbas.ru